



ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク

認 定 証

ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インクは、
下記の試験所を審査しました。

株式会社 日本遮蔽技研 福島校正センター

〒969-1113 福島県本宮市本宮字坊屋敷 276

ここに本組織が、以下の認知された国際規格に基づき、認定されたことを証します。

ISO/IEC 17025:2017

本認定により、以下の範囲及び試験所品質マネジメントシステムの運営における技術的能力を
実証するものとします。(2017年4月発行 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケに準ずる)

電氣的校正
(詳細は付属書に記述)

上記試験及び/又は校正サービスに対する認定資格は本認定証内で言及された住所のみを対象とする。本認定は、
上記規格の認定を管理するシステム規定に従い授与され、組織はその規定を遵守し、認定機関の任務を尊重する
ことをここに誓約する。

PJLA

初回認定日	発行日	認定証有効期限
2018年12月3日	2024年12月23日	2027年2月28日

認定番号
98357

認定証番号
L24-975

トレーシー サーツェン
プレジデント

Perry Johnson Laboratory
Accreditation, Inc. (PJLA)
755 W. Big Beaver Rd., Suite 1325
Troy, Michigan 48084

この認定証の有効性は、持続された認定に基づく継続審査を通して維持されています。
PJLA ウェブサイト (www.pjlab.com) でご確認ください。

尚、本認定証は日本語翻訳版であり、英文の認定証を正式のものとする。



認定証付属書

株式会社 日本遮蔽技研 福島校正センター

〒969-1113 福島県本宮市本宮字坊屋敷 276

平山 貴浩 Tel: 0243-24-9355

本認定を、上記組織の実施する下記校正について授与する。

電氣的校正

校正を受けた計量機器または計測器	範囲または必要に応じて基準装置サイズ	不確かさとして表現された校正測定能力(+/-)	使用された校正機器および基準、規格
空間線量計 ^F	1 $\mu\text{Sv/h}$ to 50 $\mu\text{Sv/h}$	0.091 $\mu\text{Sv/h}/\mu\text{Sv/h}$ + 4.6 $\mu\text{Sv/h}$	JIS Z 4511:2018, 9.4.2 置換法 I (X線及び γ 線用線量[率]測定器の校正方法)に基づく 「標準校正作業手順書 (NSG-6-2)」 電離箱 γ 線照射装置
個人線量計 ^F	5 μSv to 50 μSv	0.080 $\mu\text{Sv}/\mu\text{Sv}$ + 4.0 μSv	JIS Z 4511:2018, 9.4.2 置換法 I (X線及び γ 線用線量[率]測定器の校正方法)に基づく 「標準校正作業手順書 (NSG-6-2)」 電離箱 γ 線照射装置
		0.091 $\mu\text{Sv}/\mu\text{Sv}$ + 4.6 μSv	JIS Z 4511:2018, 9.4.2 置換法 I (X線及び γ 線用線量(率)測定器の校正方法)及び付属書 JB に基づくパノラマ(2 π) γ 線照射による個人線量計の簡素化した校正方法)に基づく 「標準校正作業手順書 (NSG-6-2)」 実用標準測定器 γ 線照射装置



認定証付属書

株式会社 日本遮蔽技研 福島校正センター

〒969-1113 福島県本宮市本宮字坊屋敷 276

平山 貴浩 Tel: 0243-24-9355

本認定を、上記組織の実施する下記校正について授与する。

電気的校正

校正を受けた計量機器または計測器	範囲または必要に応じて基準装置サイズ	不確かさとして表現された校正測定能力(+/-)	使用された校正機器および基準、規格
サーバイメータ ^F	15.9 /s/cm ² at 2π (954 cpm/cm ² at 2π)	0.063 cpm/cpm + 1200 cpm	JIS Z 4329:2004, 5.2 及び 7.1.2 並びに 7.2.4 (機器効率試験法) に基づく「標準校正作業手順書 (NSG-6-2)」 β 面線源

- この認定範囲を含む校正に対して記載された CMC (校正測定能力) は、ほぼ理想的な条件下でほぼ理想的な機器をおおよそ定められた方法で校正している試験所であれば、達成しうる最小測定不確かさを表している。それは、包含係数 $k=2$ を用いて 95% の信頼水準で表される。校正されている機器の能力や性能及び校正に関連する条件は、適度にある程度理想から逸脱しうるため、試験所が行っている特定の校正に関する実際の測定不確かさは、通常同じ校正に対する CMC より大きい。
- 校正を認定する場合、校正機関の校正能力の範囲は校正を実施する際に用いる参照標準、標準物質等の最小値から最大値に起因される。従って、校正範囲の最低下限は校正機関が入手できる最低到達可能値でなければならない。
標準がない場合、手順や方法によって校正された 0 (ゼロ) の値を検証することによって、“0 点は校正ではない” とする定義を除けば、校正方法は手順に起因する。ただし、この場合、0 点の校正が全くできないとする定義は成立しないこともある。
- 上付き文字 “F” は、試験所がその恒久的施設において、示されたパラメータの校正を実施することを意味している。
(例: “Outside Micrometer” は、試験所が固定された位置でこの校正を行うことを明確にしている。)